

# 연수 제안서

연구 분야	차세대 스핀 정보소자 개발
연구 과제명	스핀기반 나노신경망모사 기술개발
연수 제안 업무	차세대스핀소자를 위한 E-beam lithography 장비 오퍼레이터
<div>- 연수기간 : 2024.09.01. ~ 2025.05.31. (채용일로부터 최초 9개월 계약, 과제 테뉴어 적용시 최대 13개월 연장가능)</div> <div>- 연수 내용 : 1. 스핀기반 나노신경망 모사 구현을 위한 소자 개발을 위한 전자빔 리소그래피 공정<ul style="list-style-type: none"><li>- E-beam lithography 장비 오퍼레이터</li><li>- E-beam lithography을 이용한 나노소자 제작 공정</li><li>- 비휘발성, 초고속, 저전력, 고집적화가 가능한 나노 스핀소자 공정 개발</li><li>- 높은 신호비 (자기저항 크기 증가)와 고효율 동작 (낮은 스위칭 전류밀도) 구현을 위한 E-beam lithography 공정 개발 담당</li></ul></div>	
연수 책임자 : 박 태 언	